中华人民共和国国家知识产权局

| | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | T |
|-------------------|--|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 邮政编码: 1 | | | | Parameter Maria | 初田田小 |
| | 北京市西城区金融 | 上大街 27 号投资广场 | | 一多黑 | 《 N H H H 升 经 |
| | 中国专利代理 | (香港) 有限公司 | | Eps. | 4 |
| | 吴增勇 | 叶恺东 | | 审查员签章 | 105 |
| 申请号 | 00806031.2 | 部门及通知书类型 | | 9-D | 发文日期。参迎 |
| 申请人 | | 松下电器产业株式 | 会社 | | (2003 A) |
| 发明名称 | | 内部磁屏蔽罩与阴极射线管 | | | |
| The 1s | t Office Action | → 第一次审查意 (进入国家阶段的 | 见通知 (PCT 申请) | 书 、 <i>〇</i> | Date of Issue: June 20, 2003 |
| . 🛛 依申请人 | 提出的实审请求,跟 | 据专利法第 35 条第 1 款的 | 规定,审查员 | 员对上述发明专利申 | · 「请讲行实质审查。 |
| □根据专利 | 法第 35 条第 2 款的規 | 见定,国家知识产权局专利 | 局决定自行邓 | 寸上述发明专利申请 | 进行审查。 |
| . 🛛 申请人要 | 求以其在: | | | | V |
| | | 的申请日 <u>1999</u> 年 <u>12</u> | | | |
| | | 的申请日年 | | | |
| The last the same | | 的申请日年 | | | |
| . □申请人于 | | 日提交的修改文件, | 不符合专利 | 法实施细则第 51 条 | ·的规定。 |
| | | 符合专利法第 33 条的规定。 | • | | |
| | 列步审查报告附件的中 5到全体条件第10名 | | | | |
| | | 规定所提交的修改文件的中 或 41 条规定所提交的修改 | | | |
| | 对原始提交的国际申请 | | 义作。 | | |
| | 对下述申请文件进行的 | | | | |
| □说 | | | 国际由遗文社 | 的由分泌心 | |
| | | | | | • |
| | | 页,按照依据专利合 | | | 交的修改文业. |
| | | 页,按照依据专利法 | | | |
| | | | | | |
| □权利 | 利要求 第 | 项,按照原始提交的 | 國际申请文件 | 的中文译文: | |
| | 第 | 项,按照依据专利合 | 作条约第 19 | 条规定所提交的修改 | 女文件的中文译文。 |
| | 第 | 项,按照国际初步审 | 查报告附件的 |]中文译文; | |
| | 第 | 项,按照依据专利合作 | 作条约第 28 : | 条或 41 条所提交的 | 修改文件: |
| _ | | 项,按照依据专利法 | 实施细则第 5 | 1 规定所提交的修改 | 文文件。 |
| | | | | | |
| □附图 | | 页,按照原始提出的国 | | | |
| | | 页,按照国际初步审查 | | | ~ E Hou - |
| | | 页,按照依据专利合作 | 乍条约第 28 名 | 条或 41 条所提交的 | 修改文件: - 5 NOV 2003 |
| | 一一一一一 ポートリング サンド アン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 页,按照依据专利法3 | 天施细则第 51 大轭土 (1) 左三 | 1条规定所提交的修 | 改文件。 |
| | | 献(其编号在今后的审查) | | 用): | |

回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6号 国家知识产权局专利局受理处收

References Cited

| 编号 | 文 件 号 或 名 称 | | 开 触申请 | 日期的申请 | |) |
|----|-------------|------|----------|-------|---|---|
| 1 | JP9-147757A | 1997 | 年 6 | 月 | 6 | 日 |
| 2 | CN1137165A | 1996 | 年 1 | 2 月 | 4 | 日 |
| 3 | JP8-287839A | 1996 | 年 1 | 1 月 | 1 | 日 |
| 4 | | | 年 | 月 | | 日 |

| I I | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|---|-------------|
| 4 | | | 年 | 月 | 日 |
| 6. 审查的结论性意见: | | | | | |
| □关于说明书: | | | | | |
| □申请的内容属于 | 于专利法第 5 条规定的 |]不授予专利权的范围。 | | | |
| | 专利法第 26 条第 3 款的 | | | | |
| | 专利法第 33 条的规定。 | | | | |
| | 不符合专利法实施细则 | | | | |
| ☑关于权利要求书: | | 为 16 采印灰龙。 | | | |
| ☑权利要求 | 2-6 | 不具备专利法第 22 条第 2 款规定 | マムム かて ヒモ しし | | |
| □权利要求 | | 不具备专利法第 22 条第 3 款规定 | | | |
| □权利要求 | | | | | |
| □权利要求 | | 属于专利法第 25 条规定的不授予 | | | |
| ───────────────────────────────────── | 2 | | | | |
| □权利要求 | | 不符合专利法第 31 条第 1 款的规 | | | |
| □权利要求 | | 不符合专利法第 33 条的规定。 | 上走。 | | |
| □权利要求 | | 不符合专利法实施细则第 13 条第 | 1 **** | | |
| □权利要求 | | 不符合专利法实施细则第 2 条第 | | | |
| ☑权利要求 | | 不符合专利法实施细则第 20 条的 | | | |
| □权利要求 | | 不符合专利法实施细则第 21 条的 | | | |
| | | 不符合专利法实施细则第 22 条的 | | | |
| □权利要求 | | 不符合专利法实施细则第 23 条的 | | | |
| 上述结论性意见的具体。 | | | 然 足。 | | |
| 基于上述结论性意见, | 审查员认为: | | | | |
| □申请人应按照通知书 | 正文部分提出的要求, | 对申请文件进行修改。 | | | |
| | | 可以被授予专利权的理由,并对通知书正文 | 郊公市长山西流 | か A liste | |
| 进行修改,否则将不能 | 能授予专利权。 | , | HEST 1. 18 (1) 63 A. | 17 百 次亿 | 三之处 |
| ☑专利申请中没有可以: | 被授予专利权的实质性 | 生内容,如果申请人没有陈述理由或者陈述。 | 理由不充分 甘田 | b (本)を 知 | اجا خان |
| | | | 生田小儿刀,我们 | 19171000 | 秋凹。 |
| 申请人应注意下述事项: | | | | | |
| (1) 根据专利法第37 名 | 条的规定, 申请人应在 (· | 文到本通知书之日起的 <u>肆</u> 个月内陈述意见, | 如果申请人无可 | E水油中 | 添加 |
| 不答复, 其申请将 | 被视为撤回。 | | ~~~ ~~~~~ | レコ在田 | 767 397 |
| (2) 申请人对其申请的 ⁴ | 修改应符合专利法第3 | 33 条的规定,修改文本应一式两份,其格式 | 忧应符合审查指南 | 的有关 | 排中 |
| (3) 申请人的意见陈述 | 书和 / 或修改文本应由 | 『寄或递交国家知识产权局专利局受理处,戶 | 1未邮寄或递交给 | 。 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 | 然 心。 |
| 件个具备法律效力。 | • | | | · 人工人 | HJ / |
| (4) 未经预约,申请人 | 和 / 或代理人不得前来 | · 区国家知识产权局专利局与审查员举行会晤 | • | | |
| 本通知书正文部分共有 | _ <u>2</u> 页,并附有下述的 | 寸件: | | | |
| ☑引用的对比文件的复印 | 7件共 3 份 35 | ; 7 6 | • | | |

21302

2002.7

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-147757

(43)公開日 平成9年(1997)6月6日

(51) Int.Cl.⁶

徽別記号 庁内整理番号

F I

技術表示箇所

H01J 29/02

H01J 29/02

D

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特顯平7-307134

平成7年(1995)11月27日

(71)出頭人 000006013

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(72) 発明者 中村 浩治

東京都千代田区大手町二丁目6番2号 三

菱電機エンジニアリング株式会社内

(74)代理人 弁理士 前田 実

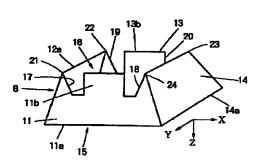
(54) 【発明の名称】 カラー陰極線管

(57)【要約】

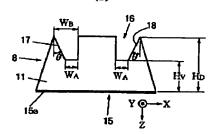
【課題】 電子ビームのランディング特性を向上させる ことによって色ずれのない、高品質な画像を表示するこ とができるカラー陰極線管を提供する。

【解決手段】 磁気シールド8が、第1の面11と、これに対向する第3の面13と、第2の面12と、これに対向する第4の面14とを有する中空でほぼ四角錐台状であり、シャドウマスク5側の第1の開口部15と電子銃6側の第2の開口部16とを有し、第1の面11の第2の開口部16側の辺の両端近傍及び第3の面13の第2の開口部16側の辺の両端近傍のみにそれぞれ切欠部17~20を形成した。





(b)



1

【特許請求の範囲】

「【請求項1】 前面パネルとファンネルとを有する外囲 器と、

上記前面パネルの内面に設けられた蛍光体スクリーン

上記蛍光体スクリーンに対向して配置され、電子ビーム を通過させる多数の通過孔を有するシャドウマスクと、 上記ファンネルのネック内に配置され、上記シャドウマ スクに向けて上記電子ビームを放射する電子銃と、

上記外囲器の内部に配置され、上記電子ビームの走行路 10 を取り囲む磁気シールドとを有するカラー陰極線管にお いて、

上記磁気シールドが、第1の面と、上記第1の面に対向 する第3の面と、第2の面と、上記第2の面に対向する 第4の面とを有し、上記シャドウマスク側の第1の開口 部と上記電子銃側の第2の開口部とを有する中空でほぼ 四角錐台状であり、上記第1の面及び第3の面の上記第 2の開口部側の辺の両端近傍にのみそれぞれ切欠部を形 成したことを特徴とするカラー陰極線管。

【請求項2】 上記第1の面の上記第2の開口部側の上 20 記切欠部に挟まれた辺の上記第1の開口部を含む基準面 から上記第2の開口部側の端部までの高さが、上記第1 の開口部を含む基準面から上記第2の開口部側の端部ま での高さより短く、かつ、上記第3の面の上記第2の開 口部側の上記切欠部に挟まれた辺の上記第1の開口部を 含む基準面から上記第2の開口部側の端部までの高さ が、上記第3の面の上記基準面から上記第2の開口部側 の端部までの高さより短いことを特徴とする請求項1に 記載のカラー陰極線管。

する請求項1又は2のいずれかに記載のカラー陰極線 管。

上記第1の面の上記第2の開口部側の上 【請求項4】 記切欠部に挟まれた辺の長さが、上記第1の面の上記切 欠部の最深部間の距離の1/2以下であり、かつ、上記 第3の面の上記第2の開口部側の上記切欠部に挟まれた 辺の長さが、上記第3の面の上記切欠部の最深部間の距 雕の1/2以下であることを特徴とする請求項1乃至3 のいずれかに記載のカラー陰極線管。

【請求項5】 上記第1の面及び上記第3の面の上記切 40 欠部の近傍に補強部材を備えたことを特徴とする請求項 1乃至4のいずれかに記載のカラー陰極線管。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、地磁気等の外部磁 界によって電子ビームに与えられる影響を軽減する内部 磁気シールドを備えたカラー陰極線管に関するものであ る。

[0002]

13号公報に開示されている従来のカラー陰極線管用の 内部磁気シールドの形状を概略的に示す斜視図である。 一般に、電子ビームが地磁気から受ける電磁力を弱める 方法としては、電子ビームに鎖交する地磁気による磁力 線の数を減らす方法と、地磁気による磁力線の方向が電 子ビームに平行な方向に近づくように電子ビームとこれ に鎖交する磁力線とがなす角度を小さくする方法とがあ る。

【0003】図9の磁気シールド40は、水平方向(X 方向) 地磁気(以下、「E/W地磁気」という。) を有 効に遮蔽することによって、管軸方向(2軸方向)に入 射する電子ビームEBに鎖交する磁力線の数を減らす機 能を持つ。しかし、この磁気シールド40は、E/W地 磁気の3倍程度の影響を電子ビームEBに及ぼす管軸方 向地磁気(以下、「N/S地磁気」という。)から受け る影響を十分に軽減することはできない。

【0004】そこで、図10の磁気シールド41が提案 されている。この磁気シールド41は、各面42~45 の中央に1つずつ切欠部42a~45aを形成すること によって、N/S地磁気による磁力線の方向を電子ピー ムEBに平行な方向に近づけ、電子ビームEBがNノS 地磁気から受ける電磁力を弱めている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、各面4 2~45の中央付近に切欠部42a~45aを有する図 10の磁気シールド41では、N/S地磁気に対する対 角部 (磁気シールドを構成する各面42~45が互いに 交わる稜の近傍) のシールド効果は向上するがシャドウ マスク側の各面42~45のX軸及びY軸端近傍(画像 【請求項3】 上記切欠部がV字形であることを特徴と 30 表示面の中心を原点とし、水平方向をX軸とし、垂直方 向をY軸とした座標系における、画像表示面内のX軸の 両端近傍及びY軸の両端近傍) におけるN/S地磁気に 対するシールド効果が不十分であるという問題があっ

> 【0006】そこで、本発明の目的は、N/S地磁気に より電子ビームに与えられる影響を更に抑制することに より、電子ビームの良好なランディング特性を得ること ができるカラー陰極線管を提供することにある。

【課題を解決するための手段】請求項1によるカラー陰 極線管は、前面パネルとファンネルとを有する外囲器 と、上記前面パネルの内面に設けられた蛍光体スクリー ンと、上記蛍光体スクリーンに対向して配置され、電子 ビームを通過させる多数の通過孔を有するシャドウマス クと、上記ファンネルのネック内に配置され、上記シャ ドウマスクに向けて上記電子ビームを放射する電子銃 と、上記外囲器の内部に配置され、上記電子ビームの走 行路を取り囲む磁気シールドとを有する。そして、上記 磁気シールドが、第1の面と、上記第1の面に対向する 【従来の技術】図9及び図10は、特開平5-1597 50 第3の面と、第2の面と、上記第2の面に対向する第4

の面とを有し、上記シャドウマスク側の第1の閉口部と 上記電子銃側の第2の開口部とを有する中空でほぼ四角 錐台状であり、上記第1の面及び第3の面の上記第2の 開口部側の辺の両端近傍にのみそれぞれ切欠部を形成し たことを特徴としている。

【0008】また、請求項2によるカラー陰極線管は、 上記第1の面の上記第2の開口部側の上記切欠部に挟ま れた辺の上記第1の開口部を含む基準面から上記第2の 開口部側の端部までの高さが、上記第1の開口部を含む く、かつ、上記第3の面の上記第2の開口部側の上記切 欠部に挟まれた辺の上記第1の開口部を含む基準面から 上記第2の開口部側の端部までの高さが、上記第3の面 の上記基準面から上記第2の開口部側の端部までの高さ より短いことを特徴としている。

【0009】また、請求項3によるカラー陰極線管は、 上記切欠部がV字形であることを特徴としている。

【0010】また、請求項4によるカラー陰極線管は、 上記第1の面の上記第2の開口部側の上記切欠部に挟ま れた辺の長さが、上記第1の面の上記切欠部の最深部間 の距離の1/2以下であり、かつ、上記第3の面の上記 第2の開口部側の上記切欠部に挟まれた辺の長さが、上 記第3の面の上記切欠部の最深部間の距離の1/2以下 であることを特徴としている。

【0011】また、請求項5によるカラー陰極線管は、 上記第1の面及び上記第3の面の上記切欠部の近傍に補 強部材を備えたことを特徴としている。

[0012]

【発明の実施の形態】

実施の形態1

図1は、本発明の実施の形態1によるカラー陰極線管の 構造を概略的に示す水平断面図である。図1に示される ように、実施の形態1によるカラー陰極線管は、正面 (図1の右側) から見た場合の形状がほぼ四角形である ガラス製前面パネル1と、この前面パネル1に接合され た漏斗状のガラス製ファンネル2とから構成される外囲 器3を有する。また、このカラー陰極線管は、前面パネ ル1の内面に設けられ、赤、緑、青に発光する3色の蛍 光体層からなる蛍光体スクリーン4と、この蛍光体スク リーン4に対向して配置され、電子ピームを通過させる 多数の通過孔を有するシャドウマスクラとを有する。さ らに、このカラー陰極線管は、ファンネル2のネック2 a内に配置され、シャドウマスク5に向けて3本の電子 ビーム 7 R. 7 G. 7 Bを放出する電子銃 6 と、外囲器 3の内部に電子ビームの走行路を取り囲んで配置され、 地磁気や外部回路等によって発生する外部磁界を遮蔽す る磁気シールド8とを有する。尚、図1において、9は シャドウマスクる及び磁気シールド8を支持するフレー ム、10は電子ビーム7R、7G、7Bを走査させる偏 向ヨークを示す。

【0013】図2 (a) は磁気シールド8の形状を示す 斜視図、図2(b)は磁気シールド8の切欠部を示す説 明図である。磁気シールド8は、板厚が0.1 [mm] ~0.3 [mm]程度の金属磁性体板により形成されて いる。この金属磁性体板に適した材料には、例えば、リ ムド鋼又はアルミキルド鋼があるが、他の磁性体であっ てもよい。図2(a)に示されるように、磁気シールド 8は、中空であり、ほぼ四角錐台状であり、X-2面 (水平面)に対して傾斜した第1の面(上面)11と、 基準面から上記第2の開口部側の端部までの高さより短 10 X-2面に対して傾斜し、第1の面11に対向する第3 の面(下面)13と、Y-Z面(垂直面)に対して傾斜 した第2の面(左面)12と、Y-Z面に対して傾斜 し、第2の面12に対向する第4の面(右面)14とを 有する。また、図1及び図2(a),(b)に示される ように、磁気シールド8は、シャドウマスク5側に大径 の第1の開口部15を有し、電子銃6側に小径の第2の 開口部16を有する。尚、横(水平方向)に長い画面を 持つカラー陰極線管の場合には、第1及び第3の面1 1. 13の第1の開口部15側の辺(例えば、図2 (a) における辺11a)、即ち、X方向の辺は、第2

及び第4の面12、14の第1の開口部15側の辺(例 えば、図2(a)における辺14a)、即ち、Y方向の 辺より長い。また、第1乃至第4の面11~14は平面 に限らず、曲面であってもよい。

【0014】そして、実施の形態1における磁気シール ド8は、第1の面11の第2の開口部16側の辺の両端 近傍のみに切欠部17.18を形成し、第3の面13の 第2の開口部16側の辺の両端近傍のみに切欠部19. 20を形成している。

【0015】ここで、第1の面11に1対の切欠部1 7, 18を形成し、第3の面13に1対の切欠部19, 20を形成した理由は、第2の開口部16から侵入する N/S地磁気による磁力線を第2の開口部16側の各面 11~14が接する角部21~24に集中させ、N/S 地磁気による磁力線の方向と電子ピームの方向とがなす 角度を小さくすることによって、電子ビームがN/S地 磁気から受ける力を弱めるためである。

【0016】また、第1の面11の両端近傍のみに切欠 部17.18を形成し、これら1対の切欠部17.18 の間に突起部11bを残し、第3の面13の両端近傍の みに切欠部19,20を形成し、これら1対の切欠部1 9.20の間に突起部13bを残した理由は、第1の面 11のX軸及びY軸端近傍 (画像表示面の中心を原点と し、水平方向をX軸とし、垂直方向をY軸とした座標系 における、画像表示面内のX軸の両端近傍及びY軸の両 端近傍)における電子ビームに鎖交する磁力線の数及び 第3の面13のX軸及びY軸端近傍における電子ビーム に鎖交する磁力線の数を減らすためである。言い換えれ ば、磁気シールドを構成する各面の中央部に切欠部を設 50 けた従来の磁気シールド (例えば、図10に示されるも

5

の)では不十分であったX軸及びY軸端近傍におけるN **/S地磁気の遮蔽効果を向上させるためである。**

【0017】以上説明したように、実施の形態1のカラ ー陰極線管によれば、E/W地磁気による電子ビームの 影響を抑えながら、N/S地磁気による電子ビームの影 響を更に軽減させることができる。

【0018】図3は、実施の形態1によるカラー降極線 管における、切欠部17~20の深さ(H_o-H_v)とN /S地磁気による電子ビーム移動量との関係を示すグラ フである。ここで、Hoは、第1の開口部15を含む基 準面15aから磁気シールド8の第2の開口部16側の 端部までの高さを示し、Hvは、基準面15aから切欠 部17~20の底部までの高さを示す。図3において、 曲線25は切欠部17~20の深さ(H_b-H_v)に対す る、対角部で生じる電子ビームの最大移動量 [μm]を 示し、曲線26は切欠部17~20の深さ(HpーHv) に対する、X軸及びY軸端近傍の電子ビームの移動量 [um]を示す。図3の曲線25から、切欠部17~2

0の深さ(H_b-H_v)が増すほど、対角部で生じる電子 ことがわかる。また、図3の曲線26から、切欠部17 ~20の深さ(HoーHv)を増しても、X軸及びY軸端 近傍の電子ビームの移動量 [um] を、ほとんど増加さ せていないことがわかる。

【0019】図4は、図10の従来の磁気シールドにつ いて、切欠部の深さとN/S地磁気による電子ビーム移 動量との関係を示すグラフである。図4において、曲線 27は切欠部の深さに対する、対角部で生じる電子ビー ムの最大移動量 [μm] を示し、曲線28は切欠部の深 · [μm]を示す。図4の曲線27から、切欠部の深さが 増すほど、電子ビームの最大移動量 [μm] を小さくす ることができるが、曲線28から、切欠部の深さが増す ほど、X軸及びY軸端近傍の電子ビームの移動量 [μ m] が増加してしまうことがわかる。

【0020】ここで、図3及び図4に示される値は実験 により得られたものである。また、実験に用いた磁気シ ールドは、15インチCRT(三菱電機株式会社製)用 のものであり、その寸法は以下の通りである。

[0021]

第1の開口部のX軸方向の幅=280 [mm] 第2の開口部のX軸方向の幅=126 [mm] 切欠部の底部の幅W_A = 10 [mm]

切欠部の最大幅W。 = 4 6 [mm]

第1及び第3の面11.13の高さH。=84 [mm] 切欠部17~20の底部の高さH_v = 54 [mm] 及び $H_v = 69 [mm]$

【0022】また、実施の形態1において、切欠部17 ~20の形状、深さ(H。-Hv)及び幅(底部の幅W。 及び最大幅W。)、第1及び第3の面11、13の高さ

H_o、切欠部17~20の底部の高さH_v、高さH_oに対 する高さHvの割合いHv/Ho、切欠部17~20の傾 斜端の角度 θ などの値は、カラー陰極線管の形状や大き さ等の諸条件、カラー陰極線管を使用する環境条件、及 びN/S地磁気とE/W地磁気のいずれの影響を優先的 に防止するか等のような設計要求に基づいて定めればよ い。また、切欠部17~20の傾斜端の角度θは、次式 $0 \le \theta \le 60$ (1)

を満足することが望ましい。また、切欠部17~20の 10 底部の高さH_vは、次式

 $0.3 \times H_0 \leq H_v \leq 0.7 \times H_0$ (2) を満足することが望ましい。

【0023】尚、上記説明においては、磁気シールド8 の第2の開口部16の長辺に切欠部を形成した場合につ いて説明したが、第2の開口部16の短辺の両端近傍に 切欠部を形成しても外部磁界の影響を軽減することがで

【0024】実施の形態2

図 5 (a). (b)は、本発明の実施の形態 2 によるカ ピームの最大移動量 [μm]を小さくすることができる 20 ラー陰極線管の磁気シールド30を示すものであり、同 図(a)は磁気シールド30の形状を示す斜視図、同図 (b) は磁気シールド30の切欠部を示す説明図であ る。この磁気シールド30は、基準面15aから切欠部 17.18の間の突起部11b及び切欠部19.20の 間の突起部13bの第2の開口部16側の端部までの高 さH_τを、基準面15aから第2の面12及び第4の面 14の第2の開口部16側の端部での高さH。よりも低 くしている点のみが、実施の形態1の場合と相違する。 実施の形態2の場合にも実施の形態1の場合とほぼ同様 さに対する、X軸及びY軸端近傍の電子ビームの移動量 30 に、X軸及びY軸端近傍におけるシールド効果が向上す るという効果が得られ、しかも対角部におけるシールド 効果が更に向上するという効果が得られる。実施の形態 2において、上記以外の点は、実施の形態1の場合と同 一である。

【0025】実施の形態3

図6 (a), (b)は、本発明の実施の形態3によるカ ラー陰極線管の磁気シールド31を示すものであり、同 図(a)は磁気シールド31の形状を示す斜視図、同図 (b) は磁気シールド31の切欠部を示す説明図であ 40 る。実施の形態3による磁気シールド31は、切欠部1 7~20をV字状に形成している点のみが、実施の形態 1の場合と相違する。実施の形態3の場合にも実施の形 態1の場合とほぼ同様な効果が得られる。しかも、切欠 部の深さが同一である場合、第1及び第3の面11.1 3が変形し難いという効果がある。実施の形態 3 におい て、上記以外の点は、実施の形態1の場合と同一であ

【0026】実施の形態4

図7 (a), (b)は、本発明の実施の形態4によるカ 50 ラー陰極線管の磁気シールド32を示すものであり、同 図(a)は磁気シールド32の形状を示す斜視図、同図(b)は磁気シールド32の切欠部を示す説明図である。実施の形態4による磁気シールド32は、切欠部17~20をV字状に形成している点、及び、第1及び第3の面11、13の突起部11b、13bの上辺の長さしか、切欠部17、18又は切欠部19、20の最深部間の距離しの1/2以下になるように形成している点のみが、実施の形態1の場合と相違する。実施の形態4の場合にも実施の形態1の場合とほぼ同様に、X軸及びY軸端近傍におけるシールド効果が向上するとともに、対角部におけるシールド効果が向上するとともに、対角部におけるシールド効果が更に向上するという効果が得られる。実施の形態4において、上記以外の点は、実施の形態1の場合と同一である。

【0027】実施の形態5

図8 (a). (b)は、本発明の実施の形態 5 によるカラー陰極線管の磁気シールド 3 3 を示すものであり、同図(a)は磁気シールド 3 3 の形状を示す斜視図、同図 す説明図である。(b)は磁気シールド 3 3 の切欠部を示す説明図である。実施の形態 5 による磁気シールド 3 3 は、切欠部 17~2 0 の近傍に機械的強度を補強するビード 3 4 を備まる。実施の形態 5 による磁気シールド 3 3 は、切欠部 17~2 0 の近傍に機械的強度を補強するビード 3 4 を備まる。実施の形態 5 の場合と相違する。実施の形態 5 の場合にも実施の形態 1 の場合とほぼ同様な物果が得られる。実施の形態 5 において、上記以外の点は、実施の形態 1 の場合と同一である。 【図 1 0 】 従来のは、実施の形態 1 の場合と同一である。

[0028]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 E/W地磁気による電子ビームの影響を抑えながら、N /S地磁気による電子ビームの影響を更に軽減させるこ とができるので、電子ビームの良好なランディング特性 を得ることができ、高品質な画像を表示できるという効 果が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施の形態1によるカラー陰極線管の構造を概略的に示す水平断面図である。

* 【図2】 (a) は図1の磁気シールドを示す斜視図、 (b) は図1の磁気シールドの切欠部を示す説明図である。

【図3】 切欠部の深さ(HoーHv)とN/S地磁気による電子ピーム移動量との関係を示すグラフである。

【図4】、従来の磁気シールドについて、切欠部の深さとN/S地磁気による電子ピーム移動量との関係を示すグラフである。

【図5】 (a) は実施の形態2における磁気シールド 10 を示す斜視図、(b) はこの磁気シールドの切欠部を示す説明図である。

【図6】 (a) は実施の形態3における磁気シールドを示す斜視図、(b) はこの磁気シールドの切欠部を示す説明図である。

【図7】 (a) は実施の形態 4 における磁気シールドを示す斜視図、(b) はこの磁気シールドの切欠部を示す説明図である。

【図8】 (a) は実施の形態 5 における磁気シールド を示す斜視図、(b) はこの磁気シールドの切欠部を示す説明図である。

【図9】 従来の磁気シールドの形状を概略的に示す斜 視図である。

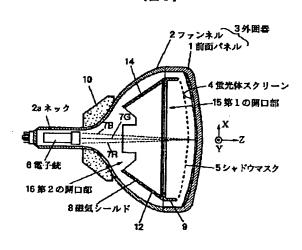
【図10】 従来の磁気シールドの他の形状を概略的に示す斜視図である。

【符号の説明】

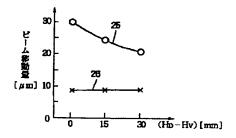
30

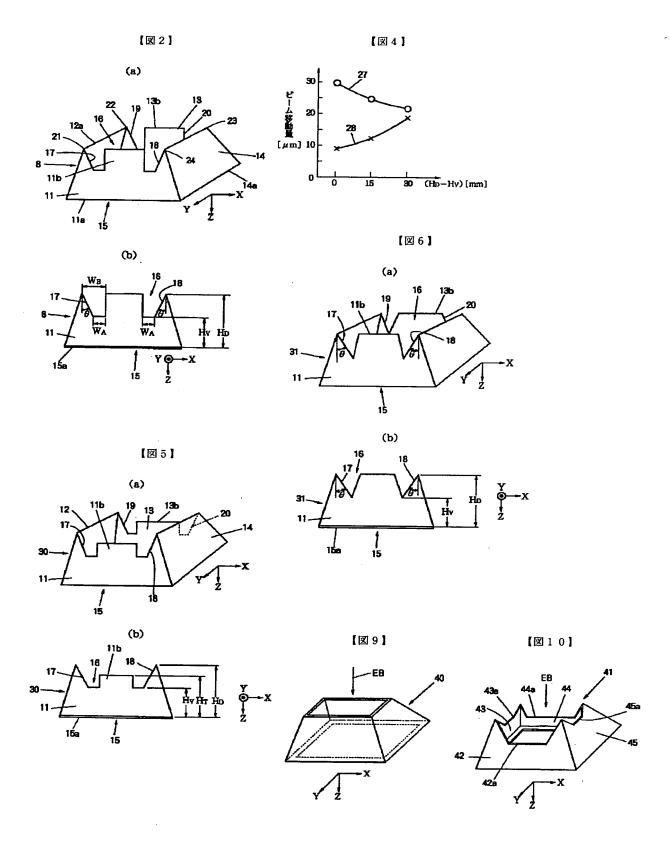
 1 前面パネル、 2 ファンネル、 2 a ネック、 3 外囲器、 4蛍光体スクリーン、 5 シャドウマスク、 6 電子銃、 7R.7G.7B電子ビーム、 8.30、31、32、33 磁気シールド、 11 第1の面、 12 第2の面、 13 第3の面、 14 第4の面、 15 第1の開口部、 16 第2の開口部、 17、18、19、20 切欠部、 34ビード。

[図1]

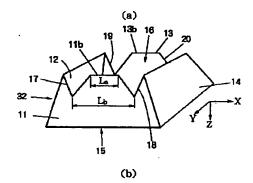


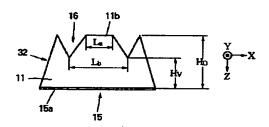
【図3】





【図7】





【図8】

